

第62回春季学術講演会 プログラム編集委員リスト

中分類分科名		Section	委員(所属) 下線は大分類分科代表又は合同セッション代表
1.1	応用物理一般・学際領域	Interdisciplinary and general physics	面谷信 (東海大)
1.2	教育	Education	鈴木芳文 (九工大)
1.3	新技術・複合新領域	Novel technologies and interdisciplinary engineering	松谷晃宏 (東工大)
1.4	エネルギー変換・貯蔵	Energy conversion and storage	小栗和也 (東海大)
1.5	資源・環境	Resources and environment	小栗和也 (東海大)
1.6	計測技術・計測標準	Instrumentation, measurement and metrology	寺崎正 (産総研)
1.7	超音波	Ultrasonic	近藤淳 (静岡大)
2.1	放射線物理一般・検出器基礎	Radiation physics and Detector fundamentals	伏見賢一 (徳島大), 越水正典 (東北大), 人見啓太郎 (東北大)
2.2	検出器開発	Detection systems	
2.3	放射線応用・発生装置・新技術	Application, radiation generators, new technology	
3.0	Optics and Photonics English Session	Optics and Photonics English Session	未定
3.1	光学基礎・光学新領域	Basic optics and frontier of optics	居波渉 (静岡大)
3.2	材料・機器光学	Equipment optics and materials	石飛秀和 (阪大), 望月博孝 (産総研), 昨野靖行 (キヤノン), 片山龍一 (福岡工大)
3.3	情報フォトンクス・画像工学	Information photonics and image engineering	的場修 (神戸大), 片山龍一 (福岡工大)
3.4	生体・医用光学	Biomedical optics	松浦祐司 (東北大), 西館泉 (農工大)
3.5	レーザー装置・材料	Laser system and materials	興雄司 (九大), 時田茂樹 (阪大), 宮本克彦 (千葉大)
3.6	超高速・高強度レーザー	Ultrashort-pulse and high-intensity lasers	石川顕一 (東大), 石澤淳 (NTT)
3.7	レーザープロセッシング	Laser processing	細川陽一郎 (奈良先端大), 佐藤正健 (産総研)
3.8	光計測技術・機器	Optical measurement, instrumentation, and sensor	平井亜紀子 (産総研), 塩田達俊 (埼玉大), 柴田泰邦 (首都大)
3.9	テラヘルツ全般	THz technology	河野行雄 (東工大), 山下将嗣 (理研)
3.10	光量子物理・技術	Optical quantum physics and technologies	行方直人 (日大)
3.11	フォトンクス構造・現象	Photonic structures and phenomena	新家昭彦 (NTT), 浅野卓 (京大)
3.12	ナノ領域光科学・近接場光学	Nanoscale optical science and near-field optics	酒井優 (山梨大), 岩見健太郎 (農工大)
3.13	半導体光デバイス	Semiconductor optical devices	下村和彦 (上智大), 中村滋 (NEC), 荒川太郎 (横国大)
3.14	光制御デバイス・光ファイバー	Optical control devices and optical fiber	石月秀貴 (NINS), 渡辺俊夫 (NTT), 和田篤 (防衛大)
3.15	シリコンフォトンクス	Silicon photonics	森雅彦 (産総研)
6.1	強誘電体薄膜	Ferroelectric thin films	坂本渉 (名大), 三浦薫 (キヤノン)
6.2	カーボン系薄膜	Carbon-based thin films	神田一浩 (兵庫県立大), 小倉政彦 (産総研)
6.3	酸化物エレクトロニクス	Oxide electronics	廣瀬靖 (東大), 神吉輝夫 (阪大)
6.4	薄膜新材料	Thin films and New materials	中村吉伸 (東大), 土屋哲男 (産総研)
6.5	表面物理・真空	Surface Physics, Vacuum	高見知秀 (広島大), 山田洋一 (筑波大)
6.6	プローブ顕微鏡	Probe Microscopy	福岡剛士 (金沢大), 山田豊和 (千葉大)
7.1	X線技術	X-ray technologies	寺岡有殿 (原子力機構), 江島丈雄 (東北大)
7.2	電子ビーム応用	Applications and technologies of electron beams	川崎忠寛 (JFCC), 根尾陽一郎 (静岡大)
7.3	微細パターン・微細構造形成技術	Micro/Nano patterning and fabrication	山崎謙治 (NTT), 須賀治 (EIDEC), 横尾篤 (NTT)
7.4	量子ビーム界面構造計測	Buried interface sciences with quantum beam	桜井健次 (NIMS)
7.5	原子・分子線およびビーム関連新技術	Atomic/molecular beams and beam-related new technologies	田川雅人 (神戸大)
7.6	イオンビーム一般	Ion beams	種村真幸 (名古屋工大)
8.0	Plasma Electronics English Session	Plasma Electronics English Session	佐藤孝紀 (室蘭工大)
8.1	プラズマ生成・制御	Plasma production and control	柳生義人 (佐世保高専)
8.2	プラズマ診断・計測	Plasma measurements and diagnostics	伊藤剛仁 (阪大)
8.3	プラズマ成膜・表面処理	Plasma deposition of thin film and surface treatment	太田貴之 (名城大)
8.4	プラズマエッチング	Plasma etching	前田賢治 (日立)
8.5	プラズマナノテクノロジー	Plasma nanotechnology	佐藤孝紀 (室蘭工大), 金子俊郎 (東北大)
8.6	プラズマライフサイエンス	Plasma life sciences	山田英明 (産総研)
8.7	プラズマ現象・新応用・融合分野	Plasma phenomena, emerging area of plasmas and their new applications	小田昭紀 (千葉工大)
8.8	プラズマエレクトロニクス分科内招待講演	プラズマエレクトロニクス分科内招待講演	佐藤孝紀 (室蘭工大)
9.1	誘電材料・誘電体	Dielectrics, ferroelectrics	塚田真也 (島根大)
9.2	ナノワイヤ・ナノ粒子	Nanowires and Nanoparticles	原真二郎 (北大), 古藤誠 (キヤノン)
9.3	ナノエレクトロニクス	Nanoelectronics	島田宏 (電通大)
9.4	熱電変換	Thermoelectric conversion	中津川博 (横国大), 竹内恒博 (豊田工大)
9.5	新機能材料・新物性	New functional materials and new physical properties	高瀬浩一 (日大)
10.1	新物質創成 (酸化物・ホイスラー・金属磁性体等)	Emerging materials in spintronics and magnetism (excluding semiconductors)	近藤剛 (東芝)
10.2	スピントルク・スピン流・回路・測定技術	Spin torque, spin current, circuits, and measurement technologies	大兼幹彦 (東北大)
10.3	GMR・TMR・磁気記録技術	Giant magnetoresistance (GMR), tunnel magnetoresistance (TMR) and magnetic recording technologies	三輪真嗣 (阪大)
10.4	半導体・有機・光・量子スピントロニクス	Semiconductors, organic, optical, and quantum spintronics	好田誠 (東北大)
10.5	磁場応用	Application of magnetic field	山本勲 (横国大)
11.1	基礎物性	Fundamental properties	山本秀樹 (NTT), 入江晃亘 (宇都宮大)
11.2	薄膜, 厚膜, テープ作製プロセスおよび結晶成長	Thin and thick superconducting films, coated conductors and film crystal growth	一野祐亮 (名大)
11.3	臨界電流, 超伝導パワー応用	Critical Current, Superconducting Power Applications	小田部荘司 (九工大)
11.4	アナログ応用および関連技術	Analog applications and their related technologies	紀和利彦 (岡山大)
11.5	接合, 回路作製プロセスおよびデジタル応用	Junction and circuit fabrication processes, digital applications	山梨裕希 (横国大)

12.1	作製・構造制御	Fabrications and Structure Controls	三崎雅裕(神戸大), 三浦康弘(桐蔭横浜大), 松井淳(山形大)
12.2	評価・基礎物性	Characterization and Materials Physics	古川一暁(NTT), 解良聡(NINS), 久保野敦史(静岡大)
12.3	機能材料・萌芽的デバイス	Functional Materials and Novel Devices	福田武司(埼玉大), 山下兼一(京都工繊大), 永野修作(名大), 尾崎良太郎(愛媛大), 奥崎秀典(山梨大)
12.4	有機EL・トランジスタ	Organic light-emitting devices and organic transistors	横山大輔(山形大), 永瀬隆(大阪府大), 坂上知(早大), 深川弘彦(NHK)
12.5	有機太陽電池	Organic solar cells	久保貴哉(東大), 嘉治寿彦(農工大), 尾坂格(理研)
12.6	ナノバイオテクノロジー	Nanobiotechnology	住友弘二(NTT), 熊谷慎也(豊田工大)
12.7	医用工学・バイオチップ	Biomedical Engineering and Biochips	柳瀬雄輝(広島大), 笹川清隆(奈良先端大), 宮本浩一郎(東北大)
13.1	Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション	Fundamental properties, surface and interface, and simulations of Si related materials	上野智雄(農工大), 嵯峨幸一郎(ソニー), 森伸也(阪大)
13.2	探索的材料物性・基礎物性	Exploratory Materials, Physical Properties, Devices	寺井慶和(鹿児島大), 末益崇(筑波大)
13.3	絶縁膜技術	Insulator technology	石田猛(日立), 小山正人(東芝)
13.4	Siプロセス・配線・MEMS・集積化技術	Si wafer processing /MEMS/Integration technology	小川真一(産総研), 中村友二(富士通), 上野和良(芝浦工大), 河本直哉(山口大), 角嶋邦之(東工大), 町田克之(NTT-AT), 佐々木実(豊田工大), 石井仁(豊橋技科大), 永瀬雅夫(徳島大)
13.5	デバイス/集積化技術	Semiconductor devices and related technologies	右田真司(産総研), 入沢寿史(東芝)
13.6	Semiconductor English Session	Semiconductor English Session	未定
13.7	超薄膜・量子ナノ構造	Quantum properties and fabrications of nanoscale structures and devices	宮澤俊之(東大), 俵毅彦(NTT), 早瀬潤子(慶大), 尾崎信彦(和歌山大)
13.8	化合物及びパワー電子デバイス・プロセス技術	Compound and power electron devices and process technology	中村成志(首都大), 塩島謙次(福井大), 牧山剛三(富士通研), 末光哲也(東北大)
13.9	光物性・発光デバイス	Optical properties and light-emitting devices	小泉淳(阪大), 國本崇(徳島文理大), 深田晴己(金沢工大), 今北健二(神戸大)
13.10	化合物太陽電池	Compound solar cells	杉山睦(東理大), 八木修平(埼玉大)
15.1	バルク結晶成長	Bulk crystal growth	荻野拓(東大)
15.2	II-VI族結晶および多元系結晶	II-VI and related compounds	阿部友紀(鳥取大), 宇野和行(和歌山大), 田橋正浩(中部大)
15.3	III-V族エピタキシャル結晶	III-V-group epitaxial crystals	杉山正和(東大), 荒井昌和(NTT)
15.4	III-V族窒化物結晶	III-V-group nitride crystals	片山竜二(東北大), 高橋邦方(パナソニック), 大矢昌輝(エルシード), 山口智広(工学院大), 村上尚(農工大)
15.5	IV族結晶, IV-IV族混晶	Group IV crystals and alloys	澤野憲太郎(東京都市大)
15.6	IV族系化合物	Group IV Compound Semiconductors	矢野裕司(筑波大)
15.7	エピタキシーの基礎	Fundamentals of epitaxy	杉山正和(東大)
15.8	結晶評価, 不純物・結晶欠陥	Crystal evaluation, impurities and crystal defects	深田直樹(物材機構), 杵掛健太朗(東北大)
16.1	基礎物性・評価	Fundamental properties and their evaluation in disordered materials	吉田憲充(岐阜大), 梶原浩一(首都大)
16.2	プロセス技術・デバイス	Processing technologies and devices	大平圭介(北陸先端大), 傍島靖(阪大)
16.3	シリコン系太陽電池	Bulk, thin-film and other silicon-based solar cells	小出直城(シャープ), 寺川朗(パナソニック), 石河泰明(奈良先端大)
17.1	成長技術	Growth technology	佐藤信太郎(富士通研), 野内亮(大阪府立大), 吹留博一(東北大), 長汐晃輔(東大), 前橋兼三(農工大), 神田晶申(筑波大), 田中丈士(産総研), 千足昇平(東大), 藤井健志(富士電機)
17.2	構造制御・プロセス	Structural control and process	
17.3	新機能探索・基礎物性評価	Exploration of new functions and evaluation of basic properties	
17.4	デバイス応用	Device applications	

<p>薄膜・表面の6.3酸化物エレクトロニクス, 6.4薄膜新材料, および結晶工学15.2 II-VI族結晶および多元系結晶で企画した合同セッションです。</p>	<p>This is a joint session of 6.3 Oxide-based electronics, 6.4 New thin film materials in 6. Thin Films and Surfaces and 15.2 II-VI-group crystals and multicomponent crystals in 15. Crystal Engineering.</p>	<p>廣瀬靖(東大), 神吉輝夫(阪大), 中村吉伸(東大), 土屋哲男(産総研), 阿部友紀(鳥取大), 田橋正浩(中部大), 川原村敏幸(高知科大)</p>
--	--	--